Новые дизайны лазерных переходов квантово-каскадных структур ТГц диапазона для получения высокой мощности и для работы при повышенных температурах

Д.В. Ушаков^{1*}, А.А. Афоненко¹, Р.А. Хабибуллин², А.А. Васильевский³, В.И. Гавриленко⁴

1 Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь.

2 Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН, Нагорный пр., 7/5, Москва, 117105.

ЗНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ, 1115409, Москва, Россия.

4 Институт физики микроструктур РАН, ул. Академическая, д. 7, Нижний Новгород, 607680.

*ushakovdv@bsu.by

Предложены два новых дизайна лазерных переходов квантово-каскадных структур на основе GaAs/AlGaAs для получения высокой мощности излучения и увеличения рабочих температур. Первый дизайн основан на использовании двух фотонной схемы лазерных переходов, что обуславливает приближенно в 2 раза более медленное насыщение коэффициента усиления с ростом плотности фотонов и высокую расчетную мощность (~600 мВт) при азотных температурах. Второй дизайн основан на концепции использования рабочих уровней с волновыми функциями, простирающимися на два и более периода структуры, что позволяет увеличить матричный элемент дипольных переходов. При этом, нижний лазерный уровень имеет больший энергетических зазор с инжектором, менее заселен и температурно стабилен по сравнению с традиционными дизайнами, что позволяет ожидать максимальную рабочую температуру ~250 К.

Введение

Реализованные в настоящее время квантовокаскадные лазеры (ККЛ) преимущественно созданы на основе структур GaAs/AlGaAs с дизайном «резонансное испускание оптического фонона» [1–5]. В терагерцовой области частот рабочие температуры постоянно повышались как за счет минимизации потерь [2, 6], так и оптимизации матричных элементов дипольных переходов Z_{nm} между рабочими уровнями и числа квантовых ям (КЯ) [1–6]. Для уменьшения утечек в континуум предлагались схемы с увеличенной высотой барьерных слоев [7–8].

В настоящей работе предложены новые конструкции ТГц ККЛ на основе GaAs/AlGaAs и обсуждаются особенности двух разработанных дизайнов лазерных переходов для получения высокой мощности излучения и увеличения рабочих температур.

Теоретическая модель и новые дизайны лазерных переходов

Вольт-амперная характеристика каскада находилась методом балансных уравнений с периодическими граничными условиями [9–10]. Базисные волновые функции находились **k p**-методом [10] с последующим преобразованием специального вида для учета дефазировки [9,10]. Вероятности переходов учитывали процессы туннелирования, электрон-электронного рассеяния, рассеяния на оптических фононах, заряженных примесях, шероховатостях гетерограниц.

Основной задачей проектирования ККЛ является получение усиления структуры на возрастающем участке вольт-амперной характеристики. Первый дизайн – для получения высокой мощности излучения получен путем сканирования толщин барьерных слоев и КЯ для активной области из 4-х КЯ. На рисунке 1 а-в приведены расчеты уровней энергии и волновых функций, а также температурные зависимости населенностей уровней, спектры усиления и мощности излучения для одной из оптимальных структур Al_{0.15}Ga_{0.85}As/GaAs, слои которой составляют 3.39/16.37/5.08/8.47/2.26/9.03/2.26/7.9 нм. Центральная часть широкой КЯ легирована примесями со слоевой концентрацией 4.6·10¹⁰ см⁻². Схема лазерных переходов основана на использовании туннелирования с уровня инжектора 1' на верхний рабочий уровень 5, двух последовательных лазерных переходов (5-4 и 4-3) и опустошения нижнего рабочего уровня 3 за счет туннелирования на уровень 2 и резонансного испускания оптического фонона. При этом, рабочее напряжение на одном каскаде близко к сумме двух энергий излучения и энергии продольного оптического фонона 2 ћω+ћω_{LO}. Эффективность схемы 2 ћю+ћоьо



Рис. 1. (a, r) Диаграммы зоны проводимости и квадраты модулей волновых функций электронов, рассчитанные k p -методом, для оптимизированных ТГц ККЛ на основе GaAs/AlGaAs при напряжении на каскаде V₁=65.5 (a) и 52.5 мВ (r) и температуре *T*=77 (a) и 200 К (r), температурные зависимости населенностей энергетических уровней (б, д), а также (в, е) коэффициентов усиления и потерь на частоте генерации и мощности излучения

подтверждается приближенно в 2 раза более медленным насыщением коэффициента усиления с ростом плотности фотонов по сравнению с традиционной схемой $\hbar\omega + \hbar\omega_{LO}$. Расчеты на рисунке 1 в показывают, что при азотных температурах достигается высокое значение мощности ~600 мВт, а максимальная рабочая температура составляет 180 К.

Второй дизайн для повышения рабочих температур ККЛ основан на концепции использования слабо локализованных состояний с волновыми функциями, простирающимися на два и более периодов структуры [10]. На рисунке 1 г-е приведены расчеты уровней энергии и волновых функций, а также температурных характеристик для одной из оптимальных структур, толщины слоев которой барьер/КЯ слева направо имеют следующие значения: 2.26/12.99/3.39/3.39 нм. Центральная часть широкой КЯ легирована примесями со слоевой концентрацией 3·10¹⁰ см⁻². В предложенном дизайне волновые функции, соответствующие рабочим уровням 3 и 2, оказываются протяженными и слабо локализованными. При этом достигается большой матричный элемент дипольных переходов Z₃₂ = 6 нм. Предложенный дизайн с 2 КЯ характеризуется гибридной схемой накачки, основанной на резонансных туннельных переходах с уровня инжектора 1' на верхний лазерный уровень 3 следующего периода. Однако, населенность верхнего лазерного уровня 3 слабо связана с населенностью инжекторного уровня 1' и синхронизирована через

электрон-фононное взаимодействие с населенностью нижнего лазерного уровня 2 следующего (предыдущего) периода. При этом, расчетное значение максимальной рабочей температуры составляет ~250 К.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-72-30020.

Литература

- B.S. Williams// Nature Photonics, V. 1, 517 (2007).
- H. Luo, S.R. Laframboise, Z.R. Wasilewski et al. // Appl. Phys. Lett., V. 90, 041112 (2007).
- M.A. Belkin, J.A. Fan, S. Hormoz et al. // Opt. Exp., V. 16, 3242 (2008).
- S. Kumar, Q. Hu, and J. L. Reno // Appl. Phys. Lett., V. 94, 131105 (2009).
- S. Fathololoumi, E. Dupont, C.W.I. Chan et al. // Optics Express, V. 20, 3866 (2012).
- Д.В. Ушаков, А.А. Афоненко, А.А. Дубинов и др. // Квантовая электроника, Т. 48, 1005 (2018).
- L. Bosco, M. Franckie, G. Scalari et al.// Appl. Phys. Lett., V. 115, 010601(2019).
- A. Khalatpour, A.K. Paulsen, C. Deimert et al. // Nature Photonics, V. 15, 16 (2021).
- Д.В. Ушаков, А.А. Афоненко, А.А. Дубинов и др. // Квантовая электроника, Т. 49, 913 (2019).
- D. Ushakov, A. Afonenko, R. Khabibullin, et al. // Opt. Express, 28 (17), 25371 (2020).